

No	装置				装置設置場所		
	分類1	装置名	メーカー	Maker	部屋	内線	
	分類2		型名	type	メール		
28	クリーン ルーム内 設置装置	マスクアライナー	ミカサ	Mikasa			創成科学 研究棟
		Mask Aligner	MA-20	MA-20	nano- support@es.hokudai		
29	クリーン ルーム内 設置装置	真空蒸着装置	サンバック	SANVAC			創成科学 研究棟
		Vacuum Evaporation Chamber	ED-1500R	ED-1500R	nano- support@es.hokudai.ac.jp		
30	クリーン ルーム内 設置装置	反応性イオンエッチング装置	サムコ	SAMCO			創成科学 研究棟
		Reactive Ion Etching System	RIE-10NRV	RIE-10NRV	nano- support@es.hokudai.ac.jp		
31	クリーン ルーム内 設置装置	ICP高密度プラズマエッチング装置	サムコ	SAMCO			創成科学 研究棟
		Inductively Coupled Plasma high-density etching facility	RIE-101iHS	RIE-101iHS	nano- support@es.hokudai.ac.jp		
32	クリーン ルーム内 設置装置	プラズマCVD装置	サムコ	Samco			創成科学 研究棟
-32		Plasma-enhanced chemical vapor deposition system	PD-220ESN	PD-220ESN	nano- support@es.hokudai.ac.jp		
33	クリーン ルーム内 設置装置	ICPドライエッチング装置	住友精密工業	Sumitomo Precision			創成科学 研究棟
-33		Inductively Coupled Plasma dry-etching facility	SPM-200	SPM-200	nano- support@es.hokudai.ac.jp		
34	クリーン ルーム内 設置装置	液体ソースプラズマCVD装置	サムコ	SAMCO			創成科学 研究棟
		Plasma-enhanced liquid source chemical vapor deposition system	PD-10C1	PD-10C1	nano- support@es.hokudai.ac.jp		
35	クリーン ルーム内 設置装置	ヘリコンスパッタリング装置	アルバック	ULVAC			創成科学 研究棟
		Helicon sputtering system	MPS-4000C1/HC1	MPS-4000C1/HC1	nano- support@es.hokudai.ac.jp		
36	クリーン ルーム内 設置装置	電子線照射装置	日立	Hitachi	02-304	9338	創成科学 研究棟
		Electron Beam Lithography System	S-4200特SE	S-4200*SE	k- ueno@es.hokudai.ac.jp		
37	クリーン ルーム内 設置装置	超高精度電子ビーム描画装置	エリオニクス	ELIONIX			創成科学 研究棟
		Ultra-high precision electron beam lithography system 125kV	ELS-F125-U	ELS-F125-U	nano- support@es.hokudai.ac.jp		

No	装置				装置設置場所		
	分類1	装置名	メーカー	Maker	部屋	内線	
	分類2		型名	type	メール		
83	クリーンルーム内設置装置	ドライエッチング装置	アルバック	ULVAC			創成科学研究棟
		Dry Etching	NLD-500	NLD-500	nano-support@es.hokudai		
84	クリーンルーム内設置装置	反応性イオンエッチング装置	サムコ	SAMCO			創成科学研究棟
		INDUCTIVELY COUPLE	RIE-101iPH	RIE-101iPH	nano-support@es.hokudai.ac.jp		
85	クリーンルーム内設置装置	レーザー描画装置	ネオアーク	NEOARK			創成科学研究棟
		Laser Direct Lithography	DDB-201-200	DDB-201-200	nano-support@es.hokudai.ac.jp		
86	クリーンルーム内設置装置	原子層堆積装置	Picosun	Picosun			創成科学研究棟
		Atomic Layer Deposition	SUNALE-R	SUNALE-R	nano-support@es.hokudai.ac.jp		
87	専用測定装置	ソーラシミュレータ	ワコム電創	WACOM			創成科学研究棟
		SUPER SOLAR SIMULATOR	WXS-156S-L2,AM1.5	WXS-156S-L2,AM1.5	nano-support@es.hokudai.ac.jp		
95	成膜・加工装置	イオンビームスパッタ装置	アルバック	ULVAC			創成科学研究棟
		ion beam lithography system	IBS-6000S	IBS-6000S	nano-support@es.hokudai.ac.jp		
96	成膜・加工装置	イオンミリング装置	アルバック	ULVAC			創成科学研究棟
		Ion milling system	IBE-6000S	IBE-6000S	nano-support@es.hokudai.ac.jp		
97	分光分析装置	時間分解磁気光学効果測定	自作	Self-made			工学部L棟
		time-resolved magneto-optical spectroscopy system	特型	-	murayama@ist.hokudai.ac.jp		
104	バイオ関連分析装置	高速レーザー共焦点顕微鏡	ニコン	Nikon	03-305	9340	電子科学研究所
		High Speed Laser	A1	A1	nic@es.hokudai.ac.jp		
105	バイオ関連分析装置	全反射蛍光顕微鏡	ニコン、日本ローパー	Nikon,Nippon Roper	03-305	9340	電子科学研究所
		Total Internal Reflection(TIRF) Microscopy	TE-2000,EM-CCDカメラ	TE-2000,EM-CCD	nic@es.hokudai.ac.jp		

40	電磁波分析装置	高分解能X線回折装置	ブルカー・エイエック	BRUKER AXS			創成科学研究棟
	X線	Material research diffractometer	D8 Discover	D8 Discover	nano-support@es.hokudai.ac.jp		
41	電磁波分析装置	超薄膜評価装置	日立	Hitachi			創成科学研究棟
	分光	Ultra-thin Film Evaluation System	HD-2000	HD-2000	nano-support@es.hokudai.ac.jp		
42	成膜・加工装置	集束イオンビーム加工観察装置	日立	Hitachi			創成科学研究棟
		Focused Ion Beam System	FB-2100	FB-2100	nano-support@es.hokudai.ac.jp		
43	電磁波分析装置	レーザーゼータ電位計	大塚電子	Otsuka Electronics	04-304	9360	未指定
	分光	Electrophretic Light Scattering Spectrophotometer	ELS-8000	ELS-8000	ijiro@poly.es.hokudai.ac.jp		
44	電磁波分析装置	X線回折装置	リガク	Rigaku			創成科学研究棟
	X線	X-ray diffractometer	RINT-2000/PC	RINT-2000/PC	nano-support@es.hokudai.ac.jp		
45	電磁波分析装置	X線光電子分光装置	日本電子	JEOL			創成科学研究棟
	X線	X-Ray Photoelectron Spectrometer	JPS-9200	JPS-9200	nano-support@es.hokudai.ac.jp		
46	分光分析装置	FT-IR（フーリエ変換赤外線吸収分光光度計）	日本分光	JASCO			創成科学研究棟
		FT infrared absorption spectrophotometer (FT-IR)	FT/IR 660Plus	FT/IR 660Plus	nano-support@es.hokudai.ac.jp		
47	表面分析・形態観測用装置	分子間力プローブ顕微鏡	Asylum Research	Asylum Research			創成科学研究棟
		Atomic Force Microscope	MFP-3D (Molecular Force Probe 3D)	MFP-3D (Molecular Force Probe 3D)	nano-support@es.hokudai.ac.jp		
48	表面分析・形態観測用装置	走査型レーザー生物顕微鏡	オリンパス	Olympus	04-304	9360	創成科学研究棟
		Laser scanning bio microscope	FV-300	FV-300	ijiro@poly.es.hokudai.ac.jp		
49	分光分析装置	紫外可視近赤外分光光度計	パーキンエルマー	PERKIN ELMER			創成科学研究棟
		Ultraviolet and visible near-infrared spectrophotometer	Lamda 900S	Lamda 900S	nano-support@es.hokudai.ac.jp		

106	バイオ関連分析装置	多色蛍光タイムラプス顕微	ニコン	Nikon	03-305	9340	電子科学研究所
		Multi color and Time-lapse	Ti-E	Ti-E	nic@es.hokudai.ac.jp		
107	バイオ関連分析装置	リアルタイム共焦点顕微鏡	ニコン、横河電機	Nikon, Yokogawa Electric Corporation	03-305	9340	電子科学研究所
		Real-time Confocal Microscopy	Ti,CSU-10	Ti,CSU-10	nic@es.hokudai.ac.jp		
108	クリーンルーム内設置装置	電子線描画装置	エリオニクス	ELIONIX			工学部L棟
	工学部棟内	Electron beam lithography	ERA-8000FE	ERA-8000FE	electronics_tech@ist.hokudai.ac.jp		
109	クリーンルーム内設置装置	集束イオンビーム加工装置	エリオニクス	ELIONIX			工学部L棟
	工学部棟内	Focused ion beam system	EIP-3300	EIP-3300	sueoka@ist.hokudai.ac.jp		
114	画像分析装置	多光子励起共焦点レーザー走査型多機能顕微鏡システム	オリンパス、スペクトラ・フィジックス	Olympus, Spectra-Physics			電子科学研究所
		Multiphoton excitation	FV300-TP2-SK,MaiTa	FV300-TP2-SK,MaiTa	nic@es.hokudai.ac.jp		
115	バイオ関連分析装置	ABI PRISM 3100 DNA sequencer	ライフテクノロジーズ	Life Technologies			次世代物質生命科学研究センター2期棟
		ABI PRISM 3100	ABI PRISM 3100	ABI PRISM 3100	akita@sci.hokudai.ac.jp		
117	分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置	マイクロ波試料前処理装置	マイルストーン・ネラル	Milestone General	02-321	9230	創成科学研究棟
		High performance microwave digestion system	ETHOS One	ETHOS One	tomokazu_yoshizawa@cris.hokudai.ac.jp		
118	環境試験装置	環境試験装置	Thermotron	Thermotron			創成科学研究棟
		Environmental Test Chambers	S-8-8200	S-8-8200	tota@eng.hokudai.ac.jp		
128	バイオ関連分析装置	細胞インキュベーター・蛍光顕微鏡	オリンパス	Olympus			創成科学研究棟
		Cell incubator fluorescence microscopy	LCV110	LCV110	mitomo@poly.es.hokudai.ac.jp		
129	バイオ関連分析装置	熱レンズ顕微鏡システム	マイクロ化学技研	Institute of Microchemical Technology			創成科学研究棟
		Thermal lens microscope	ITLM-10	ITLM-10	mitomo@poly.es.hokudai.ac.jp		

50	バイオ関連分析装置	細胞調製システム	三洋電機 バイオメ ディカ	Sanyo Electric Biomedic al			創成科学 研究棟
		GMP compliant cell processing system	-	-	nano- support@es.hokudai .ac.jp		
58	クリーン ルーム内 設置装置	真空紫外光露光装置	エヌ工房	N- KOUBOU			創成科学 研究棟
		Vacuum ultraviolet photolithography (exposure) device	フォトク リエー ター PC-01-H	Photocre ator PC- 01-H	nano- support@es.hokudai .ac.jp		
59	クリーン ルーム内 設置装置	分子線エビタキシー装置	Riber	Riber			創成科学 研究棟
		Molecular epitaxy system	32P	32P	hirotaka@cris.hokud ai.ac.jp		
60	画像分析 装置	走査形プローブ顕微鏡	日本電子	JEOL			創成科学 研究棟
		Scanning probe microscope	JSPM- 5200	JSPM- 5200	hara@sci.hokudai.ac .jp		
61	画像分析 装置	電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JEOL			創成科学 研究棟
		Field emission scanning electron microscope	JSM- 6700FT	JSM- 6700FT	nano- support@es.hokudai .ac.jp		
62	画像分析 装置	走査型プローブ顕微鏡	日本電子	JEOL			創成科学 研究棟
		Scanning probe microscope	JSPM- 4210	JSPM- 4210	nano- support@es.hokudai .ac.jp		
63	画像分析 装置	走査型電子顕微鏡	日立ハイ テクノロ ジーズ	Hitachi Hightech nologies			創成科学 研究棟
		Scanning electron microscope	S-3500N	S-3500N	nano- support@es.hokudai .ac.jp		
77	クリーン ルーム内 設置装置	超高精度電子ビーム描画装 置	エリオニ クス	ELIONIX			創成科学 研究棟
		Ultra-high precision electron beam lithography system 100kV	ELS- 7000HM	ELS- 7000HM	nano- support@es.hokudai .ac.jp		
81	電磁気分 析装置	磁気特性測定装置 MPMS	カンタ ム・デザ イン	Quntum Design			電子科学 研究所
	伝導率測 定	Magnetic Property Measurement System	MPMS- XL50JS	MPMS- XL50JS	ktakahashi@es.hoku dai.ac.jp		
82	電磁気分 析装置	物理特性測定装置 PPMS	カンタ ム・デザ イン	Quntum Design			電子科学 研究所
	伝導率測 定	Physical Property Measurement System	PPMS- 9LIS	PPMS- 9LIS	ktakahashi@es.hoku dai.ac.jp		

131	クリーン ルーム内 設置装置	コンパクトス タ装置	アルバッ ク	ULVAC			創成科学 研究棟
	創成棟内	Compact Sputter System	ACS- 4000-C3- HS	ACS- 4000-C3- HS	nano- support@es.hokudai .ac.jp		
145	クリーン ルーム内 設置装置	超高速ス キャン高 精度電子	エリオニ クス	ELIONIX			創成科学 研究棟
		Ultra- high speed scanning electron beam	ELS- F130HM	ELS- F130HM	nano- support@es.hokudai .ac.jp		
146	クリーン ルーム内 設置装置	半導体薄 膜堆積装 置	パスカル	Pascal			創成科学 研究棟
		Semicond uctor thin film layer	PAC- LMBE	PAC- LMBE	nano- support@es.hokudai .ac.jp		
147	電磁波分 析装置	時間分解 光電子顕 微鏡シス	エルミ テック	Elmitec			創成科学 研究棟
	分光	Time- resolved photoelec tron	PEEM-III	PEEM-III	nano- support@es.hokudai .ac.jp		
148	画像取得 装置	収差補正 走査型透 過電子顕 微鏡	日本電子	JEOL			創成科学 研究棟
		Aberratio n corrected scanning transmiss ion	JEM- ARM200F	JEM- ARM200F	nano- support@es.hokudai .ac.jp		
149	電磁波分 析装置	粉末X線 回折装置	リガク	Rigaku			電子科学 研究所
	X線	Powder X-ray diffracto meter	RINT- UltimaIII	RINT- UltimaIII	ktakahashi@es.hoku dai.ac.jp		
179	専用測定 装置	複合量子 ビーム超 高圧電子 顕微鏡	日本電子	JEOL			工学部新 世代先端 材料研究 実験棟
		Multi- beam Ultra- high	JEM- ARM1300	JEM- ARM1300	denken@eng.hokuda i.ac.jp		
180	専用測定 装置	レーザー 超高圧電 子顕微鏡	日立	Hitachi			工学部EM 棟
		Pulsed- laser- equipped	H-1300	H-1300	denken@eng.hokuda i.ac.jp		